### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-193598

(43)公開日 平成6年(1994)7月12日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

G

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

F 0 4 D 29/58

F 0 4 C 2/00

8311-3H

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-220428

(22)出願日

平成 4年(1992) 8月19日

(71)出願人 000004097

日本原子力研究所

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地

(72)発明者 加藤 崇

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1

日本原子力研究所那珂研究所内

(72)発明者 河野 勝巳

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1

日本原子力研究所那珂研究所内

(74)代理人 弁理士 西澤 利夫

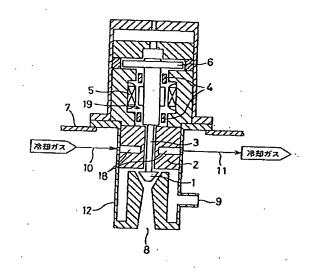
最終頁に続く

### (54)【発明の名称】 極低温回転機器

#### (57)【要約】

【目的】侵入熱を低減させ、断熱効率の向上した極低温 回転機器を提供する。

【構成】インペラー1と、このインペラー1の背面部から軸受部4、6の間に挿入した断熱材2と、回転軸3の一部とをケーシング12内に収納し、かつ断熱材2の一部に、ケーシング12を貫通して液体窒素温度レベルまで冷却した、作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材2およびケーシング12を冷却する冷却ガス流路を形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転軸の一端部に設けたインペラーを極 低温領域で作動させるとともに、回転軸を支承する軸受 部を液体窒素温度レベルよりも高い状態に保持する極低 温回転機器において、インペラーと、このインペラーの 背面部から軸受部の間に挿入した断熱材と、回転軸の一 部とをケーシング内に収納し、かつ断熱材の一部に、ケ ーシングを貫通して液体窒素温度レベルまで冷却した、 作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材およびケー シングを冷却する冷却ガス流路を形成してなることを特 10 徴とする極低温回転機器。

【請求項2】 断熱材を冷却した流体を回転軸に沿って 軸受方向へ導き、かつその一部を軸受室内を介して外部 へ排出させる冷却ガスラインと、他の一部を軸受室の手 前より外部へ排出させる別の冷却ガスラインとを各々形 成してなる請求項1の極低温回転機器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、極低温回転機器に関 するものである。さらに詳しくは、この発明は、超臨界 20 ヘリウムで強制冷却を行う超臨界ヘリウム循環装置等に 使用される低温排気ポンプ、超臨界ヘリウムポンプなど の極低温回転機器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、超臨界へリウム循環装置用の 極低温回転機器については、各種のものが提供されてき ており、たとえば、4K~4.2 Kのヘリウムを作動流体 とし、インペラーを回転させることにより作動流体を昇 圧させるポンプがこれまでに知られている。

【0003】このような極低温回転機器においては、軸 30 受部の温度レベルを常温とし、インペラー背面部と軸受 (ジャーナル軸受) 部との間に断熱板を設け、低温側へ 熱が侵入するのを防いでいる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 極低温回転機器は、一般に、比較的小型のものが多く、 現在のところ国内最大の処理流量の低温排気ポンプで も、その理論軸動力は350W程度に留まっている。と のため、外部から低温側への侵入熱量が断熱効率に大き く影響し、たとえば前述の低温排気ポンプの場合には、 侵入熱量Qしを50Wと仮定すると、流量Wは130g /s であることから、単位流量当りのエンタルピ<u>上</u>昇△ iは、次式より0.385 J/gとなる。

[0005]

【数1】

$$\Delta i = \frac{QL}{W}$$

【0006】理論エンタルピ上昇は、2.676 J/gであ るため、仮に侵入熱がない場合の断熱効率を0.7 とする gとなる。侵入熱(50W)の場合は、エンタルピ上昇 が3.823 + 0.385 = 4.208 J/s となり、断熱効率nad

[0007]【数2】

$$\eta \text{ ad} = \frac{2.676}{4.208} = 0.636$$

【0008】となる。すなわち、侵入熱(50♥)の影 響で6.4 %効率が下がったことになる。一方、侵入熱量 は、軸受側温度とインペラー側温度の温度差、熱伝導部 の面積および熱伝導部の長さ(温度勾配のついている軸 方向長さ) に比例する。熱伝導部の面積は、設計仕様か らインペラー外径が決まれば、全体の大きさが決まるの で改善の余地は少ない。また、熱伝導部の長さを長くす ると、回転軸長さが長くなり、回転軸の共振点が下がる ため、これについても制限がある。

【0009】との発明は、以上の通りの事情に鑑みてな されたものであり、従来の極低温回転機器の欠点を解消 し、侵入熱を低減させ、断熱効率の向上した極低温回転 機器を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】との発明は、上記の目的 を実現するために、回転軸の一端部に設けたインペラー を極低温領域で作動させるとともに、回転軸を支承する 軸受部を液体窒素温度レベルよりも高い状態に保持する 極低温回転機器において、インペラーと、このインペラ ーの背面部から軸受部の間に挿入した断熱材と、回転軸 の一部とをケーシング内に収納し、かつ断熱材の一部 に、ケーシングを貫通して液体窒素温度レベルまで冷却 した、作動流体と同質の流体を供給し、前記断熱材およ びケーシングを冷却する冷却ガス流路を形成してなると とを特徴とする極低温回転機器を提供する。

[0011]

【作 用】この発明の極低温回転機器においては、作動 流体と同質の流体を液体窒素温度レベル(80K)まで 下げ、これを断熱材の一部へ供給することにより、断熱 材およびこの断熱材を収納するケーシングを冷却するこ とができる。断熱材とインペラーとの間の温度差が小さ 40 くなり、インペラー側への侵入熱量が低減される。

【0012】また、断熱材およびケーシングを冷却した 流体を回転軸の外径に沿って軸方向へ流すことにより、 回転軸や軸受室内も冷却され、軸受部での発熱等を抑止 し、所定の温度に保持することが可能となる。

[0013]

【実施例】以下図面に沿って実施例を示し、この発明の 極低温回転機器についてさらに詳しく説明する。図1 は、この発明の極低温回転機器の一実施例を示した断面 図である。この図1の例においては、インペラー(1) と、実際のエンタルビ上昇は2.676 / 0.7 = 3.823 J/ 50 を一端部に装着した回転軸(3)の中央部および他端部 10

を、たとえば動圧型ガス軸受等のジャーナル軸受(4) およびスラスト軸受(6)により支承している。また、 回転軸(3)の駆動源として駆動用電動機(5)を配設 している。これらのジャーナル軸受(4)、スラスト軸 受(6)および電動機(5)については、それらの軸受 性能と電動機の耐寒温度の制限内(例えば-10°C以 内)で使用することができる。

【0014】たとえばHe等の極低温状態の作動流体 は、入口ノズル(8)より流入し、インペラー(1)で 昇圧された後、出口ノズル(9)より外部へ排出され る。インペラー(1)の背面部とジャーナル軸受(4) との間には、断熱材(2)を挿入しており、軸受部 (4)(6)側からインペラー(1)側への侵入熱を抑 止している。との断熱材(2)の一部には、その全周に わたって溝部(18)が設けられており、液体窒素温度 レベル(80K)付近まで冷却された、たとえばHeガ ス等の冷却ガスが供給される。この冷却ガスの供給は、 インペラー(1)、断熱材(2)および回転軸(3)の 一部を収納する深冷ケーシング(12)に設けた冷却ガ ス入口(10)を介して行われる。冷却ガスは、断熱材 20 (2) およびこの断熱材(2) を収納している深冷ケー シング(12)を冷却し、冷却ガス出口(11)より外 部へ排出される。

【0015】またこの例においては、インペラー(1) 側のHe等の作動流体および軸受室(19)側との間 に、冷却ガスの出入が発生しないような気密構造として もいる。これによって、作動流体側の条件に関係せず、 冷却ガスの圧力、流量等を調整自在とするできる。な お、極低温回転機器の本体は、この図1に例示した保冷 容器取付面(7)上に取り付けられる。

【0016】以上からも明らかであるように、この保冷 容器取付面(7)より下部は低温となり、上部は大気に 触れているので常温となる。たとえば以上の構成とする ことにより、断熱材(2)および深冷ケーシング(1 2)を液体窒素温度レベル(80K)まで冷却すること ができ、軸受室(19)側とインペラー(1)側の温度 差を、常温(20℃)の場合に比べ、

[0017]

【数3】

$$\frac{80}{293-4} = 0.277$$

【0018】倍にすることができ、侵入熱の低減が図れ る。図2は、との発明の極低温回転機器の別の例を示し た断面図である。との図2の例においては、溝部(1 8)を断熱材(2)の外周および内周の両方に設けてい る。冷却ガス入口(10)より供給されたHe等の冷却 ガスは、断熱材(2)およびこの断熱材(2)を収納す る深冷ケーシング(12)を冷却した後に、回転軸 (3)の外周に沿って流れ、その一部は、軸受室(1) 9)を通り冷却ガス出口(15)より外部へ排出され

る。冷却ガスは、軸受室(19)を通過する際に、ジャ ーナル軸受(4)、スラスト軸受(6)および電動機 (5)の発熱量を吸収することができる。

【0019】またこの例においては、軸受室(19)内 の温度が、所定の温度以下にならないように温度計(1 3)を設け、この温度計(13)の信号により、温度調 整弁(14)を作動させるようにしている。回転軸 (3)の外周に沿って流れた、他の一部の冷却ガスは、 冷却ガス出口(11)から外部へ排出される。との時、 冷却ガスが、インペラー(1)側に洩れ込むと侵入熱の 増加となるので、この例においては、インペラー(1) の出口圧力と冷却ガスの供給圧力を測定する差圧計(1 6)を設けてもいる。この差圧計(16)の値が所定の 圧力となるように、差圧調整弁(17)を作動させ、冷 却ガスがインベラー(1)側へ洩れ込むのを防止してい

る。 【0020】たとえば以上の構成により、断熱材 (2)、深冷ケーシング(12)および回転軸(3) が、液体窒素温度レベルまで冷却されるため、侵入熱の 低減が図れる。また、軸受部(4)(6)および電動機 (5) の温度上昇を効果的に抑えることが可能となる。 その結果、電動機(5)に関しては、外部から冷却水等 で冷却する必要などがなくなる。

【0021】もちろんとの発明は以上の例によって限定 されることはない。細部については様々な態様が可能な ことはいうまでもない。

[0022]

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によ って、侵入熱が低減した、高効率の極低温回転機器が提 30 供される。回転軸も冷却可能となり、侵入熱をさらに低 滅させることができる。軸受室内の軸受部および電動機 の発熱を抑えることも可能となり、外部よりこれらの部 位を冷却水で冷却する等の設備が不要となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の極低温回転機器の一実施例を示した 断面図である。

【図2】この発明の別の例を示した断面図である。 【符号の説明】

- 1 インペラー
- 40 2 断熱材
  - 3 回転軸
  - 4 ジャーナル軸受
  - 5 駆動用電動機
  - 6 スラスト軸受
  - 7 保冷容器取付面
  - 8 作動流体入口ノズル
  - 9 作動流体出口ノズル
  - 10 冷却ガス入口
  - 11 冷却ガス出口
- 50 12 深冷ケーシング

5

13 温度計

14 温度調整弁

15 冷却ガス出口

16 差圧計

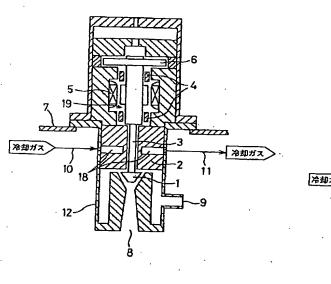
\*17 差圧調整弁

18 溝部

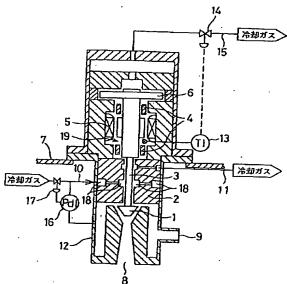
19 軸受室

\*

[図1]



【図2】



## フロントページの続き

(72)発明者 桧山 忠雄

茨城県那珂郡那珂町大字向山801番地の1 日本原子力研究所那珂研究所内

(72)発明者 吉田 純

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日 立製作所笠戸工場内 (72)発明者 岡本 和夫

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内

(72)発明者 原田 進

茨城県土浦市神立町 502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内

(72)発明者 松本 孝三

山口県下松市東豊井794番地 株式会社日

立製作所笠戸工場内